

## БИЭПИТАКСИАЛЬНАЯ ДЖОЗЕФСОНОВСКАЯ СВЯЗЬ В ПЛЕНКАХ $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-\delta}$ НА ПОДЛОЖКЕ (110) $\text{NdGaO}_3$

© Ю.А.Бойков, З.Г.Иванов\*, Т.Клаесон\*

Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук,  
194021 Санкт-Петербург, Россия

\* Chalmers University of Technology & Goteborg University,  
S-41296 Goteborg, Sweden

(Поступила в Редакцию 18 сентября 1995 г.

В окончательной редакции 28 июня 1996 г.)

Исследованы структура и параметры двухслойной эпитаксиальной системы  $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-\delta}/(\text{Y},\text{Zr})\text{O}_2$ , выращенной на подложке (110) $\text{NdGaO}_3$ . Показана возможность использования тонкого промежуточного эпитаксиального слоя  $(\text{Y},\text{Zr})\text{O}_2$  для формирования биэпитаксиальных джозефсоновских контактов в пленке  $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-\delta}$  на подложке из галлата неодима. Исследованы вольт-амперные характеристики биэпитаксиального джозефсоновского контакта при по-  
даче на него СВЧ-сигнала различной мощности.

Разработка новых биэпитаксиальных структур, включающих тонкие пленки  $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-\delta}$ (YBCO), и изучение механизмов, определяющих параметры соответствующих джозефсоновских контактов, имеют существенное значение для использования пленок высокотемпературных сверхпроводников в микроэлектронике.

Для формирования биэпитаксиальных джозефсоновских контактов в отличие от контактов, сформированных на бикристаллических подложках [1] и ступеньках [2], не требуется специально приготовленной подложки, они могут быть расположены на заданном участке подложки, выполненной из полупроводникового материала [3].

До настоящего времени исследовано лишь несколько биэпитаксиальных гетероструктур [4,5]. В литературе имеются весьма немногочисленные данные о параметрах биэпитаксиальных слабых связей, не ясно, в какой степени они определяются действующими в области кристаллографической границы механическими напряжениями, зависят от нарушения стехиометрии, концентрации дефектов и т. д. Для исследованных джозефсоновских контактов на базе  $45^\circ$  кристаллографической границы в пленке YBCO типичны, к сожалению, низкие значения произведения критического тока  $I_c$  на нормальное сопротивление  $R_n$  ( $T = 77 \text{ K}$ ) [4].

В [6] рассмотрена возможность использования подложек из галлата неодима  $\text{NdGaO}_3$  (NGO) для формирования биэпитаксиальных гетероструктур. Монокристаллические пластины NGO успешно используются для выращивания высококачественных пленок YBCO, ориентиро-

ванных осью с перпендикулярно плоскости подложки (ориентация по оси  $c$ ) [7]. При сопряжении (001)YBCO с (100) или (110)NGO различия в параметрах кристаллических решеток составляют менее 1 %. Значения температурного коэффициента линейного расширения YBCO в направлении, перпендикулярном оси  $c$ , близки к соответствующим данным для NGO.

## 1. Эксперимент

Схема двухслойной системы, использованной для формирования биэпитаксиальной кристаллографической границы в YBCO-пленке, представлена на рис. 1. Тонкий ( $d = 150 \text{ \AA}$ ) промежуточный слой  $(1 - x)\text{ZrO}_2 + x\text{Y}_2\text{O}_3$  (YSZ) был эпитаксиально выращен на поверхности NGO для того, чтобы обеспечить азимутальный разворот на 45° одной части YBCO-пленки относительно другой. Особенности сопряжения кристаллических решеток YBCO и YSZ, YSZ и NGO для случая (001)YBCO//(100)YSZ и (100)YSZ//(110)NGO проанализированы авторами в [6]. Структура и параметры эпитаксиальных пленок YBCO, выращенных на поверхности (110)NGO, исследованы в [7].

Метод лазерного распыления ( $\text{KrF}, \lambda = 248 \text{ nm}, \tau = 30 \text{ ns}$ ) был использован для выращивания эпитаксиальных пленок YSZ и YBCO. В качестве исходных мишений использовались прессованные шайбы стехиометрического состава, приготовленные по стандартной керамической технологии. Плотность лазерного излучения на поверхности мишеней равнялась  $1.5 \text{ J/cm}^2$ .

Слой YSZ (9.5 %  $\text{Y}_2\text{O}_3$ ) выращивался на поверхности (110)NGO при температуре  $T_n = 800^\circ\text{C}$  и давлении кислорода  $P_0 = 10^{-4} \text{ mbar}$ . Ионное ( $\text{Ar}$ ) травление использовалось для того, чтобы убрать промежуточный слой с половины поверхности NGO-подложки. Очистка подложки от следов фоторезиста проводилась в кислородной плазме.

Пленки YBCO ( $d = 150 \text{ nm}$ ) формировались при  $T_n = 750^\circ\text{C}$  и  $P_0 = 0.5 \text{ mbar}$ . Температура сверхпроводящего перехода  $T_c$  в пленке сверхпроводника определялась как из температурной зависимости сопротивления  $R$ , измерявшегося четырехзондовым методом, так и по изменению эффективной магнитной восприимчивости  $X$  [8].

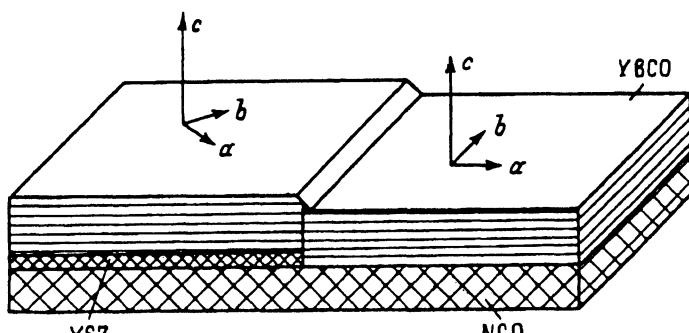


Рис. 1. Схема эпитаксиальной гетероструктуры (001)YBCO/(100)YSZ/(110)NGO, использованной для формирования биэпитаксиального джозефсоновского контакта.

Плотность критического тока  $J_c$  в пленках YBCO, выращенных на поверхности промежуточного слоя и на подложке из галлата неодима, определялась на мостиках (длиной  $50\text{ }\mu\text{m}$ , шириной  $8\text{ }\mu\text{m}$ ), сформированных с использованием ионного травления. Аналогичные мостики, пересекающие биэпитетаксиальную кристаллографическую границу, использовались для исследования вольт-амперных характеристик (ВАХ) слабых джозефсоновских связей в слое сверхпроводника. Для определения  $R_n$  по асимптоте зависимости  $dV/dI(V)$ , которая строилась с использованием численного дифференцирования, ВАХ контакта изменялась до напряжений, соответствующих  $(6-10)I_c$ .

Контроль за структурой и фазовый анализ двухслойных систем YBCO/YSZ проводились с использованием дифрактометров Philips PW 1710 ( $\theta/2\theta$ ) и Siemens 5000 ( $\varphi_1$ -сканирование) ( $\text{Cu}K_\alpha$ ).

## 2. Результаты

Тонкий промежуточный слой YSZ был выращен эпитаксиально на поверхности (110)NGO, причем (100)[010]YSZ//(110)[001]NGO (рис. 2, 3). Ось  $c$  в пленке YBCO, сформированной как на (110)NGO, так и на (100)YSZ/(110)NGO, была строго параллельна нормали к плоскости подложки (рис. 2).  $T_c$  для YBCO-пленок, выращенных на поверхности промежуточного слоя YSZ и непосредственно на NGO, находилась в пределах 87–90 К, плотность критического тока в обоих случаях превышала  $1 \cdot 10^6 \text{ A/cm}^2$  (рис. 4).

ВАХ биэпитетаксиального джозефсоновского контакта приведена на рис. 5.  $R_n$  при 77 К имело величину порядка  $1\Omega$  и слабо уменьшалось при понижении температуры. Произведение  $I_cR_n(T \sim 77 \text{ K})$  не превышало  $1-2 \mu\text{V}$ .

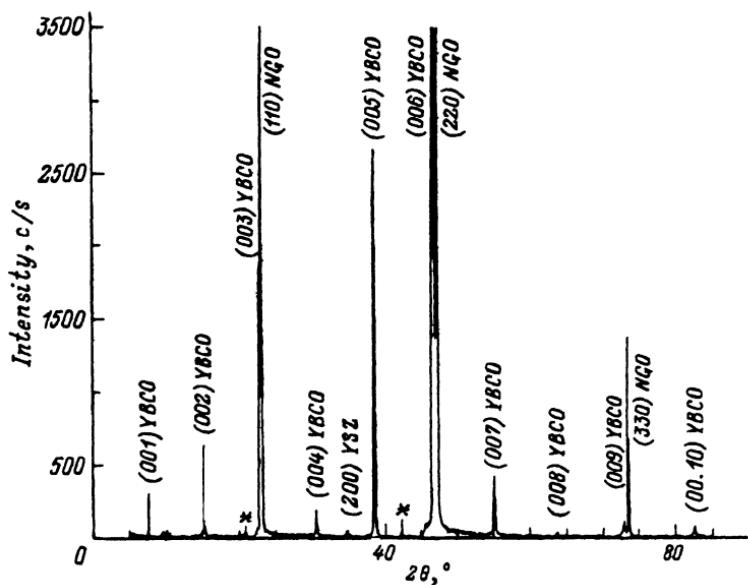


Рис. 2. Дифрактограмма ( $\theta/2\theta$ ) для двухслойной системы YBCO/YSZ, выращенной на поверхности (110)NGO.

### 3. Обсуждение полученных результатов

При указанных выше условиях конденсации YBCO-пленка, ориентированная по оси  $c$ , вырастала эпитаксиально как на поверхности промежуточного слоя YSZ, так и на подложке NGO. Пленка YBCO на поверхности слоя YSZ имела следующую азимутальную ориентацию: [110]YBCO//[010]YSZ//[001]NGO (рис. 3). Для ориентированных по оси  $c$  пленок YBCO, выращенных эпитаксиально на поверхности (110)NGO,

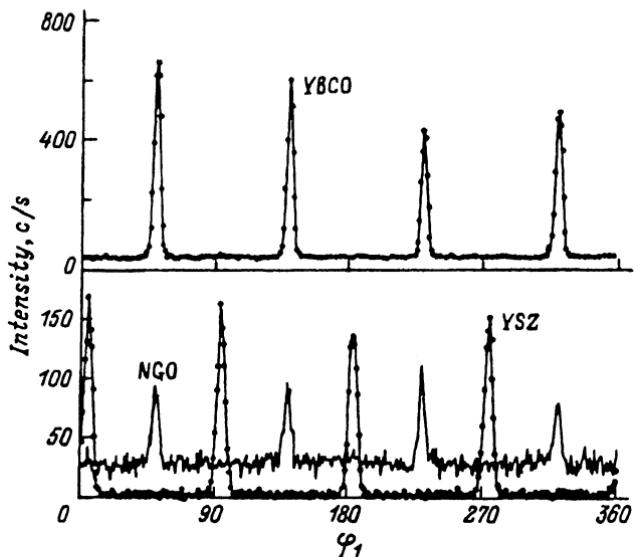


Рис. 3. Рентгеновский  $\varphi_1$ -скан для эпитаксиальной гетероструктуры (001)YBCO/(100)YSZ/(110)NGO.  
Использованы (333)NGO-, (117)YSZ- и (113)YBCO-рефлексы.

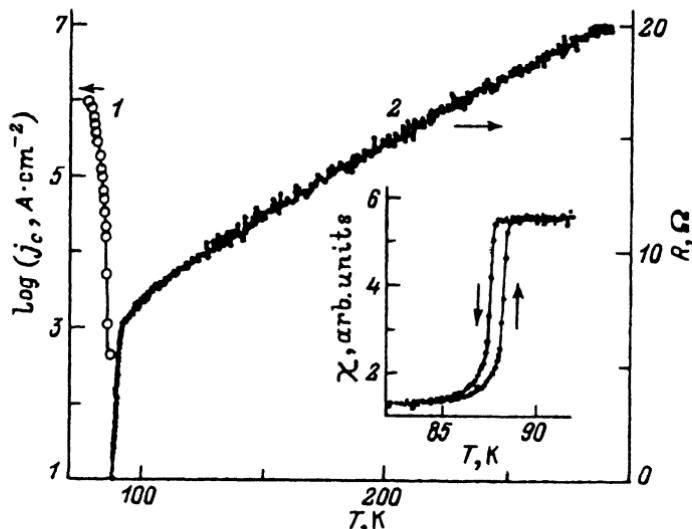


Рис. 4. Температурные зависимости  $J_c$  (1),  $R$  (2) и  $\chi$  (на вставке) для пленки YBCO, выращенной эпитаксиально на поверхности YSZ/NGO.

характерной является ориентация [010]YBCO//[001]NGO [7]. Наличие тонкого промежуточного слоя YSZ на поверхности NGO приводило, таким образом, к взаимной азимутальной разориентации на  $45^\circ$  двух соседних участков слоя сверхпроводника.

Структура и морфология поверхности слоя YSZ резко зависели от условий его формирования. Использование высоких температур конденсации и относительно низкого парциального давления кислорода в процессе формирования слоя YSZ необходимо для обеспечения высокой подвижности конденсируемых частиц, образующихся при распылении мишени YSZ. При  $T_n < 750^\circ\text{C}$  и  $P_0 > 10^{-2} \text{ mbar}$  конденсируемые частицы становятся малоподвижными вследствие активного взаимодействия ионов циркония с кислородом. В таких условиях формируется поликристаллический слой YSZ, значительную долю объема кото-

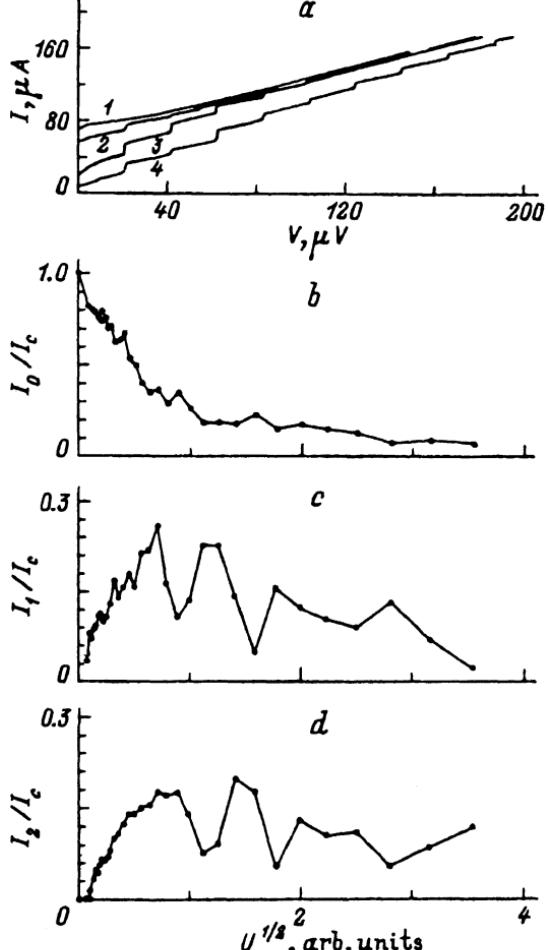


Рис. 5. а — ВАХ для биэпитаксиального джозефсоновского контакта до (1) и после (2-4) подачи на него сигнала СВЧ различной мощности  $U$ . Кривые 2-4 — соответствуют ослаблению СВЧ-сигнала на  $-25$ ,  $-15$  и  $-10 \text{ dB}$ ;  $f = 10.04 \text{ GHz}$ ;  $T = 4.2 \text{ K}$ ; б-д — изменение величины критического тока  $I_c$ , амплитуды первой  $I_1$  и второй  $I_2$  ступеней тока при увеличении  $U^{1/2}$ .

рого составляют зерна с ориентацией (110)YSZ//(110)NGO. Причины появления кристаллических зерен с тремя различными азимутальными ориентациями в пленках YBCO на подложках YSZ проанализированы авторами в [7].

Сформированные слои YSZ обладали гладкой свободной поверхностью с характерными ступенями, равными  $\sim 5 \text{ \AA}$  (параметр элементарной ячейки YSZ  $a = 5.14 \text{ \AA}$ ). Незначительное число макрочастич  $d \approx 1 \mu\text{m}$ , образовавшихся в результате наличия в паровой фазе кластеров из исходной мишени, было обнаружено на поверхности слоя YSZ с помощью микроскопа атомных сил.

Абсолютные значения  $T_c$ , полученные из данных по  $R(T)$  и  $\chi$ , хорошо коррелировали между собой. Резкое падение  $\chi$  при переходе пленки YBCO в сверхпроводящее состояние (см. вставку на рис. 4) указывает на отсутствие в исследованных пленках YBCO, выращенных на YSZ/NGO, включений фазы с пониженной  $T_c$ . К деградации сверхпроводящих свойств пленок YBCO, сформированных на YSZ, может приводить химическое взаимодействие между слоем сверхпроводника и подложкой.  $T_c$ , измеренная резистивно на мостиках, пересекающих кристаллографическую границу, была на 2–4 К ниже соответствующих данных для мостиков, не пересекающих  $45^\circ$  границу.

На рис. 5, a приведены ВАХ биэпитаксиального контакта при подаче на него СВЧ-сигнала ( $f = 10.04 \text{ GHz}$ ) различной мощности  $U$ . При нулевой мощности СВЧ-сигнала ВАХ имеет вид, типичный для резистивной модели джозефсоновского контакта. При  $U$ , отличном от нуля, на ВАХ четко видны ступени Шапиро и их высшие гармоники.

Основное уравнение джозефсоновского контакта, обладающего малой емкостью, при воздействии на него внешнего сигнала  $i = i_1 + i_2$ , где  $i_1$  и  $i_2$  — постоянный и переменный токи, пропускаемые через контакт, может быть представлено в виде [9,10]

$$(\Phi_0/2\pi R_n)d\varphi/dt + I_c \sin \varphi = i_1 + i_2, \quad (1)$$

где  $\Phi_0$  — квант магнитного потока,  $\varphi$  — разность фаз в слое сверхпроводника по обе стороны от контакта.

Амплитуда ступеней тока  $\Delta I_n$  на ВАХ при гармоническом внешнем воздействии ( $i_2 = A \cos \omega t$ ) на джозефсоновский контакт изменяется при изменении амплитуды внешнего сигнала  $A$  в соответствии с соотношением [9]

$$\Delta I_n = 2I_c|J_n(A/w)|, \quad (2)$$

где  $J_n$  — функция Бесселя. Изменение амплитуды первой  $I_1$  и второй  $I_2$  ступеней тока и величины критического тока для сформированного джозефсоновского контакта при увеличении  $U^{1/2}$  показаны на рис. 5, c, d, b. Осцилляции амплитуды ступеней тока затухали с увеличением амплитуды СВЧ-сигнала. Фазы осцилляций соседних ступеней в соответствии с (2) были сдвинуты на  $\pi/2$ .

Амплитуда ступеней тока, как следует из (2), должна обращаться в нуль при определенных значениях  $U^{1/2}$ . На экспериментальных кривых, однако, амплитуда первой и второй ступеней уменьшается до некоторой конечной величины. С увеличением мощности внешнего СВЧ-сигнала характер изменения амплитуды ступеней тока заметно

отличался от предсказываемого в рамках резистивной модели джозефсоновского контакта. Указанные расхождения между экспериментально полученными данными и теорией могут быть обусловлены: 1) сложной структурой сформированного джозефсоновского контакта (контакт состоит из двух или более контактов, соединенных параллельно [10]); 2) синхронным движением джозефсоновских вихрей в исследованном достаточно широком контакте [11,12].

В [9] предложен способ определения характерной частоты джозефсонового контакта  $\Omega_c = 2\pi V_c/\Phi_0$ , которая является одним из основных параметров резистивной модели. Для оценки  $\Omega_c$  необходимо определить величину отношения  $A_n^{k+1}/A_n^k$ , где  $A_n^k$  — амплитуда внешнего сигнала, при котором п-я ступень тока  $k$ -ый раз обращается в нуль. Значения характерного напряжения джозефсоновского контакта  $V_c$ , определенные по измерениям на постоянном токе  $V_c = I_c R_n$  и из данных по осцилляциям ступеней тока равны значения 56 и  $38 \mu\text{V}$  соответственно ( $T = 4.2 \text{ K}$ ).

Отклонения в стехиометрии в слое сверхпроводника в области бикристаллической границы, обусловленные взаимодействием YSZ и YBCO, могут оказывать существенное влияние на параметры джозефсонового контакта, в частности, являются причиной низких значений  $V_c$ . Чтобы уменьшить нарушение состава в области  $45^\circ$  кристаллографической границы, при использовании YSZ в качестве материала промежуточного слоя целесообразно использовать антидиффузионный буфер, состоящий из тонких ( $10 \text{ nm}/10 \text{ nm}$ ) эпитаксиальных слоев YBCO и SrTiO<sub>3</sub> [3].

Данная работа финансировалась в рамках проекта № 95-02-04186-а Российского фонда фундаментальных исследований.

### Список литературы

- [1] Z.C. Ivanov, P.A. Nilsson, D. Winkler, J.A. Alarco, T. Claeson. *Appl. Phys. Lett.* **59**, 23, 3030 (1991).
- [2] K. Herrmann, Y. Zhang, H.-M. Muck, J. Schubert, W. Zander, A.I. Braginski. *Supercond. Sci. Technol.* **4**, 583 (1991).
- [3] Yu.A. Boikov, Z.G. Ivanov, A.L. Vasiliev, T. Claeson. *J. Appl. Phys.* **77**, 4 1654 (1995).
- [4] K. Char, M.S. Colclough, S.M. Garrison, N. Newman, G. Zaharchuk. *Appl. Phys. Lett.* **59**, 733 (1991).
- [5] K. Char, M.S. Colclough, L.P. Lee, G. Zaharchuk. *Appl. Phys. Lett.* **59**, 17, 2177 (1991).
- [6] Yu.A. Boikov, Z.G. Ivanov, G. Brorsson, T. Claeson. *Supercond. Sci. Technol.* **7**, 281 (1994).
- [7] Ю.А. Бойков, З.Г. Иванов, Е. Олсон, В.А. Данилов, Т. Клаесон, М. Шеглов, Д. Эртс. ФТТ **37**, 3, 880 (1995).
- [8] A.T. Fiory, A.F. Hebard, P.M. Mankiewich, R.E. Howard. *Appl. Phys. Lett.* **52**, 2165 (1988).
- [9] К.К. Лихарев, Б.Т. Ульрих. Системы с джозефсоновскими контактами. Изд-во МГУ. М. (1978). С. 447.
- [10] S.G. Wang, Y.D. Dai, X.H. Zeng, G.C. Xiong, S.Z. Wang, G.J. Lian, Z.Z. Gan. *Physica B* **194–196**, 135 (1994).
- [11] R.P.J. Jsselsteijn. Laser deposited high T superconducting hetero layered structures and devices. Ph. D. Thesis. University of Twente. Netherlands. (1994). P. 91.
- [12] Yu.A. Boikov, Z.G. Ivanov, E. Olsson, J.A. Alarco, G. Brorsson, T. Claeson. *J. Appl. Phys.* **72**, 1, 199 (1992).